

TherMoiré AXP2.0 Flatness Measurement and Analysis System

TherMoiré AXP2.0 は、上下加熱オープン搭載の装置へバージョンアップしました。これにより測定サンプルにおける昇温速度の向上と面内及び表裏の温度均一性の向上を実現しました。

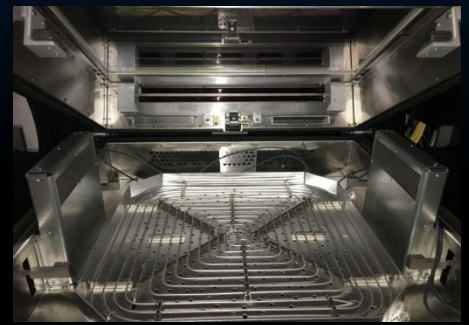
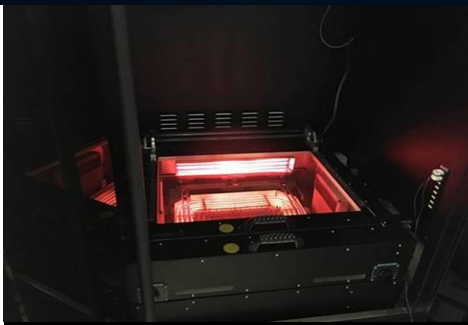
また12ビットカメラによるグレースケールの解像度アップ(255 階調 ⇒ 4,095 階調)によりサンプル準備の段階で白色スプレー塗布不要の可能性が増大しました。

実際の製造プロセスおよびオペレーティング環境による表面形状分析への最も効果的なアプローチです。



**TherMoiré AXP 2.0はサーモレイ シリーズの旗艦装置です。
拡張可能なモジュール式計測プラットフォームで多彩なオプション機能が搭載可能です。**

- ・グレーティングの選択により、サブミクロン単位のデータ取得可能
 - ・DICオプション追加でCTE値算出可能
 - ・SRTモジュール使用で、-50°Cから280°Cまでの対流冷却、加熱が可能
 - ・その他Studioソフトウェアによるさまざまな測定、解析ソリューションを提供
- * 用途に合ったオプション機能の追加可能



AXP2.0 Spec

	AXP2.0 Base Platform	AXP2.0+200LPI	AXP2.0+SRT	AXP2.0+DIC2.0	AXP2.0+DFP-M (W)
Measurement Technology	Shadow Moire	Shadow Moire	Shadow Moire	Digital Image Correlation	Digital Fringe Projection
Max FOV	375 X 375mm	375 × 375mm	150 × 70mm	75 × 75mm	180 × 135mm
Max Sample size	400 × 400mm	400 × 400mm	150 × 70mm	400 × 400mm	400 × 400mm
Min Sample size	6 × 6mm	4 × 4mm	6 × 6mm	5 × 5mm	5 × 5mm
Max Measure Coplanarity	4,000µm 100LPI	1,000µm	2,000 µm	Within Focus Range	18,000µm
Z-Resolution	3µm	1.25µm	2.5µm	1~2µm	5µm
Z Accuracy	±2.5µm / 2%	±1.25µm / 2%	±2.5µm / 2%	1~2µm	±5µm / 2%
XY-Resolution	N/A	N/A	N/A	0.5~1µm	N/A
Strain Resolution	N/A	N/A	N/A	100µStrain	N/A
Max Measure point	1447680	1447680	1447680	3,549,456	4 Mega
Max Data Density(mm2)	16	64	16	25**	1200
Thermal source	Radiant IR	Radiant IR	Convection	Radiant IR	Radiant IR
Max Heating Rate(50°C~250°C)	3.5°C/秒	3.5°C/秒	1.5°C/秒	3.5°C/秒	3.5°C/秒
Max Cooling Rate(250°C~125°C)	2.25°C/秒	2.25°C/秒	4°C/秒	2.25°C/秒	2.25°C/秒
Software	Akrometrix Studio Software	Akrometrix Studio Software	Akrometrix Studio Software	Akrometrix Studio + DIC VIC3D	Akrometrix Studio Software